



РОБОЧИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН
 на 2022/2023 навчальний рік, прийому студентів 2020 р.

ЗАТВЕРДЖУЮ
 Проректор з навчальної роботи
 _____ Анатолій МЕЛЬНИЧЕНКО
 " " _____ 2022 р.

Спеціальність 153 Мікро- та наносистемна техніка Факультет/ІНІ Факультет електроніки
 Освітня програма Мікро- та наноелектроніка Форма навчання *Очна*
 Освітній ступінь бакалавра Термін навчання 3 роки 10 місяців
 Випускова кафедра *Кафедра мікроелектроніки ФЕЛ* Кваліфікація бакалавр з мікро- та наносистемної техніки

№ п/п	Освітні компоненти (навчальні дисц., курс. пр.(роб.), практ., кваліф. роб.)	Кафедра	К-ть здобув.		Обсяг дисциплін	Аудиторні години										Контрольні заходи							Розподіл аудиторних годин на тиждень за курсами і семестрами								
			Бюджет	Контракт		Кред ECTS	Години	Всього	Лекції		Практ. (комп. прк)		Лабор		СРС	Екзамени	Заліки	МКР	Курсові роботи	Курсові проекти	РГР,РР,ГР	ДКР	Реф.	5 семестр	6 семестр						
									за НП	з урах. Інд занятъ	за НП	з урах. Інд занятъ	за НП	з урах. Інд занятъ												Інд. зан.	Всього	у т.ч.	Всього	у т.ч.	
			Лекц	Практ		Лаб	Всього	Лекц	Практ	Лаб																					
1. НОРМАТИВНІ освітні компоненти																															
Цикл загальної підготовки																															
1	Підприємницьке право	КІГАП	20	3	2.0	60	36	18	-	18	-	-	-	0	24	6	6											2	1	1	
2	Іноземна мова професійного спрямування-1	АМТС1	20	3	3	90	72	-	-	72	-	-	-	0	18	6	5						2	2			2	2	2		
Разом нормативних ОК циклу загальної підготовки					5	150	108	18	0	90	0	0	0	0	42	0	2	2	0	0	0	0	2	0	2	0	4	1	3	0	
Цикл професійної підготовки																															
3	Електродинаміка	ЕІ	20	3	5.0	150	72	54	-	18	-	-	-	0	78	5	5						4	3	1						
4	Курсова робота з електродинаміки	ЕІ	20	3	1.0	30	0	-	-	-	-	-	-	0	30	5	5														
5	Наноелектроніка	МЕ	20	3	6.0	180	90	54	-	36	-	-	-	0	90	5	5		5			5	3	2							
6	Теорія сигналів та систем	ЕІ	20	3	4.5	135	0	-	-	-	-	-	-	0	135	5															
7	Технологічні основи електроніки	МЕ	20	3	4.0	120	54	36	-	-	-	18	-	0	66	5	5			5		3	2		1						
8	Схемотехніка - 1. Аналогова схемотехніка	ЕІ	20	3	6.5	195	108	36	-	36	-	36	-	0	87	6	6									6	2	2	2		
Разом нормативних ОК циклу професійної підготовки					27	810	324	180	0	90	0	54	0	0	486	4	2	4	1	0	1	1	0	12	8	3	1	6	2	2	2
ВСЬОГО НОРМАТИВНИХ					32	960	432	198	0	180	0	54	0	0	528	4	4	6	1	0	1	1	0	14	8	5	1	10	3	5	2
2. ВИБІРКОВІ освітні компоненти																															
Вибіркові освітні компоненти з міжфакультетського/факультетського/кафедрального Ф-каталогів																															
9	Надійність електронної апаратури	МЕ	8	3	4.0	120	54	36	-	18	-	-	-	0	66	5	5			5		3	2	1							
10	Технологія інтегральних мікросхем	МЕ	11	0	4.0	120	54	36	-	18	-	-	-	0	66	5	5			5		3	2	1							
11	Мікромеханіка	МЕ	10	3	4.0	120	54	36	-	18	-	-	-	0	66	5	5			5		3	2	1							
12	Мікроелектроніка	МЕ	11	0	4.0	120	54	36	-	18	-	-	-	0	66	5	5			5		3	2	1							
13	Цифрова обробка сигналів	МЕ	10	2	4.0	120	54	36	-	18	-	-	-	0	66	6	6			6						3	2	1			
14	Структури даних	МЕ	7	3	4.0	120	54	36	-	18	-	-	-	0	66	6	6			6						3	2	1			
15	Сучасні напівпровідникові матеріали	МЕ	6	0	4.0	120	54	36	-	18	-	-	-	0	66	6	6			6						3	2	1			
16	Об'єктно-орієнтоване програмування	МЕ	12	0	4.0	120	54	36	-	18	-	-	-	0	66	6	6			6						3	2	1			
17	Функціональні діелектрики в електроніці	МЕ	10	3	4.0	120	54	36	-	18	-	-	-	0	66	6	6			6						3	2	1			
18	Інтелектуальні інформаційні системи	МЕ	11	1	4.0	120	54	36	-	18	-	-	-	0	66	6	6			6						3	2	1			
19	Технологічні основи наноелектроніки	МЕ	9	3	4.0	120	54	36	-	18	-	-	-	0	66	6	6			6						3	2	1			
20	Технологія наноматеріалів та наноструктур	МЕ	11	2	4.0	120	54	36	-	18	-	-	-	0	66	6	6			6						3	2	1			
21	Моделювання в електроніці	МЕ	11	1	4.0	120	54	36	-	18	-	-	-	0	66	6	6			6						3	2	1			
22	Основи мікро- та наносистемної техніки	МЕ	13	0	4.0	120	54	36	-	18	-	-	-	0	66	6	6			6						3	2	1			
Разом вибіркових ОК циклу професійної підготовки					28	840	378	252	0	126	0	0	0	0	462	0	7	7	0	0	4	3	0	6	4	2	0	15	10	5	0
ВСЬОГО ВИБІРКОВИХ					28	840	378	252	0	126	0	0	0	0	462	0	7	7	0	0	4	3	0	6	4	2	0	15	10	5	0
ЗАГАЛЬНА КІЛЬКІСТЬ:					60	1800	810	450	0	306	0	54	0	0	990	4	11	13	1	0	5	4	0	20	12	7	1	25	13	10	2

№ п/п	Освітні компоненти (навчальні дисц., курс. пр.(роб.), практи., кваліф. роб.)	Кафедра	К-ть здобув.			Обсяг дисциплін		Аудиторні години								Контрольні заходи								Розподіл аудиторних годин на тиждень за курсами і семестрами																													
			Бюджет	Контракт	Кред ECTS	Години	Всього	Лекції		Практ. (комп. прк)		Лабор		СРС	Екзамени	Заліки	МКР	Курсові роботи	Курсові проекти	РГР, РР, ГР	ДКР	Реф.	3 курс																														
								за НП	з урах. Інд занятя	за НП	з урах. Інд занятя	за НП	з урах. Інд занятя										Інд. зан.	ДП-01 (Б: 12, К: 1); ДП-02 (Б: 8, К: 3);																													
																										5 семестр			6 семестр																								
																							18 тижнів			18 тижнів																											
																							у т.ч.			у т.ч.																											
																							Всього	Лекц	Практ	Лаб	Всього	Лекц	Практ	Лаб																							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32																						
								Кількість								Кількість																																					
								Кількість екзаменів								4								3																													
								Кількість заліків								11								4																													
								Модульн. (темат.), контр. робіт								13								6																													
								Курсових робіт								1								1																													
								Курсових проектів								0																																					
								РГР, РР, ГР								5								2																													
								ДКР								4								2																													
								Рефератів								0																																					
								Військова підготовка у 5 - 8 семестрах за окремим планом військової підготовки																																													

Ухвалено на засіданні Вченої ради ФЕЛ ПРОТОКОЛ № 05/22 від 2022-05-31

Завідувач кафедри МЕ

(підпис)

Анатолій ОРЛОВ

Декан факультету (директор інституту)

(підпис)

Валерій ЖУЙКОВ

Примітка: РНП є частиною навчального плану і формується на основі аналізу сукупності індивідуальних навчальних планів здобувачів вищої освіти на поточний навчальний рік;